

Title (en)

Powder pumping installation, Method therefore and powder coating installation

Title (de)

Pumpeneinrichtung für Pulver, Verfahren hierfür und Pulverbeschichtungseinrichtung

Title (fr)

Installation et procédé de pompage de poudre et installation de revêtement par poudrage

Publication

**EP 1437178 A2 20040714 (DE)**

Application

**EP 03014661 A 20030627**

Priority

- DE 10300280 A 20030108
- EP 03014661 A 20030627

Abstract (en)

The particulate pump (2.1) has a timer control (74) to allow pressurized gas (36.1) into a metering feed chamber (6.1) at a preset operating point in time for a preset period. At the end of the time period, the powder mix is ejected from the metering chamber. The pump time control can be a cyclic timer to provide control signals at the ends of set time periods.

Abstract (de)

Pumpeneinrichtung für Pulver, insbesondere für Beschichtungspulver, und Pulverbeschichtungseinrichtung. Es ist eine Zeitsteuereinrichtung (74) vorgesehen, durch welche in Abhängigkeit von der seit einem vorbestimmten Betriebszeitpunkt vergangenen vorbestimmten Verzögerungszeitdauer Druckgas in eine Dosierkammer eingelassen und damit eine bis zum Ende der Verzögerungszeitdauer in die Dosierkammer eingebrachte Pulvermenge aus der Dosierkammer ausgestoßen wird. <IMAGE>

IPC 1-7

**B05B 7/14**

IPC 8 full level

**B05B 7/14** (2006.01); **B05B 12/02** (2006.01); **B65G 53/24** (2006.01); **B65G 53/34** (2006.01); **B65G 53/66** (2006.01); **F04B 9/133** (2006.01); **F04B 9/137** (2006.01); **F04B 15/02** (2006.01); **F04B 43/073** (2006.01); **F04B 53/10** (2006.01); **F16K 11/00** (2006.01); **B05B 12/14** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**B05B 7/1459** (2013.01 - EP US); **B05B 12/02** (2013.01 - KR); **F04B 9/133** (2013.01 - EP US); **F04B 9/1372** (2013.01 - EP US); **F04B 15/02** (2013.01 - EP US); **F04B 43/0736** (2013.01 - EP US); **F04B 53/1057** (2013.01 - EP US); **B05B 12/14** (2013.01 - EP US); **F04B 2201/0201** (2013.01 - EP US); **F04B 2203/0903** (2013.01 - EP US); **F04B 2207/043** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

- EP 0124933 A1 19841114 - DIETRICH FREDERIC
- EP 1106547 A1 20010613 - FREDERIC DIETRICH [CH]
- DE 3900718 A1 19900726 - DEPA GES FUER VERFAHRENSTECHNI [DE]
- DE 1087520 B 19600818 - POLYSIUS GMBH
- US 2667280 A 19540126 - LANE STANLEY C, et al
- US 3391963 A 19680709 - WEEKS WYATT J
- WO 03024612 A1 20030327 - RAMSEIER TECHNOLOGIES AG [CH], et al

Cited by

DE102015108492A1; CN103492083A; EP3155263A4; EP1728558A2; US11959469B2; WO2012139898A1; US9347444B2; US11898548B2; US10835907B2; EP2696989B1; US7648312B2; US7150585B2; US8057129B2; US8491226B2; US7478976B2; US7481605B2; WO2005116451A1; WO2021032838A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 1437178 A2 20040714**; **EP 1437178 A3 20060118**; **EP 1437178 B1 20080116**; CA 2453866 A1 20040708; CN 1517548 A 20040804; DE 10300280 A1 20040722; DE 50309018 D1 20080306; JP 2004210544 A 20040729; KR 100561219 B1 20060315; KR 20040063817 A 20040714; TW 200418704 A 20041001; TW I275555 B 20070311; US 2006159565 A1 20060720; US 7287964 B2 20071030

DOCDB simple family (application)

**EP 03014661 A 20030627**; CA 2453866 A 20031218; CN 200310123292 A 20031222; DE 10300280 A 20030108; DE 50309018 T 20030627; JP 2003435540 A 20031226; KR 20040000644 A 20040106; TW 93100311 A 20040107; US 75209904 A 20040107